

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公開番号】特開2015-36451(P2015-36451A)

【公開日】平成27年2月23日(2015.2.23)

【年通号数】公開・登録公報2015-012

【出願番号】特願2013-168591(P2013-168591)

【国際特許分類】

C 23 C 14/04 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

H 05 B 33/10 (2006.01)

【F I】

C 23 C 14/04 A

H 05 B 33/14 A

H 05 B 33/10

【手続補正書】

【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

本開示は、蒸着等に用いられるマスクに加える応力を調整する蒸着用マスク、これを用いた表示装置の製造方法に関する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0028】

本開示の第4の表示装置の製造方法では、上記本開示の第4の蒸着用マスクを用いて有機層を形成するようにしたので、精度良く有機層のパターンを形成することができ、パネルの高精細化につながる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0042】

調整機構40は、支持部材30を介して、可動部材20X, 20Y(即ちマスク本体55)に張力(引っ張り力)を加える引きボルト41と、押圧力を加える押しボルト42とを備える。図5は、この調整機構40付近のXY平面構成を表したものである。図6Aは、図5におけるII-II線断面図であり、図6Bは、図5におけるIII-III線断面図である。尚、ここでは、可動部材20X, 20Yのうち、可動部材20Yに設けられた調整機構40を例に挙げて説明する。また、図6Aおよび図6Bでは、マスク本体55と可動部材20Yとの溶接ポイントをLで示している。